ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

Н.С. Димитраки

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКА В ПРОЦЕССЕ ЕГО ВЫТЯГИВАНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ СПОСОБОМ

Технический университет Молдовы, Штефан чел Маре, 168, г. Кишинев, МД-2028, Республика Молдова

В последнее время, благодаря достижениям в технологии получения волоконно-оптических линий, новый импульс в своем развитии получили литые проводники и полупроводники (далее в тексте – проводники), вытягиваемые из жидкой фазы в виде проволоки в стеклянной оболочке. Геометрические параметры литых проводников определяются параметрами технологического процесса вытягивания их из расплава; наиболее существенными являются поперечное сечение проводника, толщина его изолирующего покрытия и их однородность по длине. Неоднородность упомянутых параметров по длине проводника негативно сказывается на качестве как самого проводника, так и изделий из него. Известно, что сечение проводника и толщина изолирующей оболочки зависят от температуры расплавов и скорости вытягивания, а их соотношение определяется однородностью преформы [1].

Известные методы литья не обеспечивают получение проводников заданных параметров с достаточной для практики точностью [2–5]. Поэтому в процессе литья проводника необходим непрерывный контроль упомянутых величин с последующей корректировкой режимов литья в случае возможных отклонений параметров проводника от заданных значений. На практике корректировка режимов осуществляется путем соответствующего изменения скорости вытягивания и температуры расплава. Если, однако, разница между заданным и эффективным значениями упомянутых величин превосходит определенное значение, то можно изменять исходную скорость преформы таким образом, чтобы скорость вытягивания поддерживалась на оптимальном уровне.

Известные оптические методы контроля [1] требуют весьма сложного измерительного оборудования, а известные электрические методы [6] не обеспечивают требуемой точности.

В настоящей работе рассматривается простой высокоточный электрический метод косвенного измерения поперечного сечения проводника. Метод основан на использовании зависимости сопротивления *R*_l проводника заданной длины *l* от его поперечного сечения *S*.

Рассмотрим принцип метода на примере проводника цилиндрической формы диаметром d. Связь между диаметром d и сопротивлением R_i проводника длиной l имеет вид:

$$d = 2\sqrt{\frac{l\rho}{\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{R_l}},\tag{1}$$

где *р* – удельное сопротивление материала проводника.

Проводник, измеряемый по этому методу, включается в измерительную цепь по трехполюсной схеме (рис. 1). На рисунке полюса обозначены цифрами 1, 2 и 3. Каждый полюс связи проводника с измерительной цепью имеет переходное сопротивление. У двух из полюсов (1 и 2) переходные сопротивления имеют комплексный характер и обозначены Z_1 и Z_2 соответственно. У третьего полюса (3) переходное сопротивление имеет чисто резистивный характер и обозначено $R_{пф}$. Измерение сопротивления проводника R_{Ix} по этому методу осуществляется путем непрерыв-

[©] Димитраки Н.С., Электронная обработка материалов, 2001, № 4, С. 87–91.

ного сравнения двух напряжений. Одно из этих напряжений пропорционально сопротивлению проводника R_l с заданными диаметром d_{3d} , удельным сопротивлением ρ_{3d} и длиной l.



Рис. 1. Эквивалентная схема включения измеряемого проводника в электрическую цепь.

Другое напряжение пропорционально сумме двух последовательно включенных сопротивлений: сопротивления R_l и сопротивления дополнительного резистора R_d , причем $R_d >> R_l$. Упомянутые напряжения сдвинуты по фазе относительно друг друга на π , непрерывно и периодически следуя друг за другом. Первое из напряжений с частотой Ω повторяется на сопротивлениях R_d и Z_l , соединенных между собой последовательно. Второе напряжение с той же частотой повторяется на измеряемом проводнике с сопротивлением R_{lx} .

Принцип метода поясняется схемами и осциллограммами, показанными на рис. 2. Дополнительный резистор с сопротивлением R_{∂} (рис. 2,*б*,*в*), измеряемый проводник с сопротивлением R_{lx} и полюса 1 и 2 с переходными сопротивлениями Z_I и $R_{n\phi}$ соответственно образуют с источником измерительного сигнала ИС последовательную электрическую цепь, по которой течет ток *I*. Источник измерительного сигнала построен таким образом, что на его выходе имеют место два независимых напряжения (рис. 2,*a*,*c*):

$$u(t) = U_m \sin(\omega t) \quad \bowtie \quad u_{on}(t) = U_{onm} \sin(\omega t + \pi).$$

Последовательная цепь, составленная из элементов с сопротивлениями R_{∂} , Z_1 , R_{lx} и $R_{n\phi}$ с помощью коммутатора K периодически подключается то к выходу с напряжением u(t), то к выходу с напряжением $u_{on}(t)$ (рис. 2, δ , ϵ). Коммутатор управляется напряжением $u_{\Omega}(t) = U_{\Omega m} sign \sin \Omega t$ с частотой $\Omega = \frac{\omega}{2\pi n}$, где ω – частота измерительного сигнала, n > 1 и целое число. В процессе последовательного периодического переключения к общей шине источника ИС подключается то измеряемый проводник (рис. 2, δ), то последовательная цепь, состоящая из R_{∂} и Z_1 (рис. 2, ϵ). Когда цепь, составленная из элементов с сопротивлениями R_{∂} , Z_l , R_{lx} и $R_{n\phi}$, подключается к выходу источника сигнала с напряжением u(t), на вход усилителя A_{ω} (точка В, рис. 2,a, δ) поступает напряжение:

$$u_{l}(t) = \frac{R_{lx} + R_{n\phi}}{R_{\phi} + Z_{1} + R_{lx} + R_{n\phi}} U_{m} \sin \omega t.$$
⁽²⁾

Напряжение $u_l(t)$ снимается с измеряемого проводника сопротивлением R_{lx} и переходного сопротивления $R_{n\phi}$ полюса 3 (рис. 2, δ). Когда эта же цепь подключена к выходу с напряжением $u_{on}(t)$, то на усилитель поступает напряжение:

$$u_{\partial}(t) = \frac{R_{\partial} + Z_1}{R_{\partial} + Z_1 + R_{lx} + R_{n\phi}} U_{onm} \sin\left(\omega t + \pi\right).$$
(3)

Напряжение $u_{\partial}(t)$ снимается с последовательной цепи R_{∂} , Z_{I} (рис. 2, δ).

Каждому диаметру проводника при одном и том же ρ соответствует свое соотношение между U_m и U_{onm} , которое определяется равенством (4):

$$\frac{U_{onm}}{U_m} = \frac{R_l}{R_o}.$$
(4)



Таким образом, при непрерывном функционировании коммутатора на усилитель A_{ω} воздействует напряжение $u_{1}(t)$ (рис. 2, *г*), состоящее из пакетов радиоимпульсов $u_{1}(t)$ и $u_{\partial}(t)$, сдвинутых по фазе относительно друг друга на π . Напряжение $u_{1}(t)$, усиленное усилителем A_{ω} , возбуждает амплитудный детектор АД. На выходе АД при этом образуется напряжение u_{3}^{1} , равное

$$u_{3} = u_{3}' = \frac{k_{21}k_{10}S_{32}\omega}{2\pi} \cdot \frac{(R_{lx} + R_{n\phi})}{R_{\phi}} \int_{0}^{\pi/\omega} U_{m}\sin(\omega t)dt.$$
 (5)

При воздействии напряжения $u_{\partial}(t)$ на усилительный тракт на выходе детектора образуется напряжение $u_{\partial}^{"}$, равное

$$u_{3} = u_{3}^{"} = \frac{k_{21}k_{10}S_{32}\omega}{2\pi} \cdot \frac{R_{l}}{R_{o}} \int_{0}^{\pi/\omega} U_{onm}\sin(\omega t + \pi)dt.$$
 (6)

Таким образом, на выходе детектора будет присутствовать переменное напряжение с амплитудой U_{m4} и частотой Ω , равное

$$U_{m4} = \frac{k_{43}\Omega}{2\pi} \left[\int_{0}^{\pi/\omega} u_{3}' dt - \int_{0}^{\pi/\omega} u_{3}'' dt \right].$$
(7)

В выражениях (5)–(7) приняты обозначения: k_{10} – коэффициент передачи полюса с импедансом Z_2 на частоте измерительного сигнала ω , k_{21} – коэффициент передачи усилителя $A\omega$, S_{32} – крутизна характеристики преобразования амплитудного детектора АД, k_{43} – коэффициент передачи фильтра низких частот. С учетом выражений (5)–(7) напряжение на выходе фазового детектора равно

$$U_{\phi \overline{A}} = k_{10} k_{21} k_{43} k_{54} S_{32} U_{m4} \frac{R_l - (R_{lx} + R_{n\phi})}{R_{\phi}},$$
(8)

где *k*₅₄ – коэффициент передачи фазового детектора.

Условием получения проводника заданного диаметра является выполнение равенства:

$$R_{lx} + R_{n\phi} = R_l. \tag{9}$$

Из соотношения (9), с учетом (1), получим

$$R_{lx} = 4\rho \frac{l}{\pi d^2} = R_l - R_{n\phi} = 4\rho_{3\partial} \frac{l}{\pi d_{3\partial}^2} - 4\rho \frac{l_{n\phi}}{\pi D_{n\phi}^2}.$$
 (10)

Когда $\rho = \rho_{3\partial}$, выражение (10) принимает вид:

$$\frac{l}{d^2} = \frac{l}{d_{30}^2} - \frac{l_{n\phi}}{D_{n\phi}^2},$$
(11)

откуда

$$d = d_{_{3\partial}} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{l_{n\phi}}{l} \left(\frac{d_{_{3\partial}}}{D_{n\phi}}\right)^2}} > d_{_{3\partial}}.$$
(12)

Когда $\frac{l_{\scriptscriptstyle n\phi}}{l} \left(\frac{d_{\scriptscriptstyle s\partial}}{D_{\scriptscriptstyle n\phi}} \right)^2 <<1$ (как правило, $d_{\scriptscriptstyle s\partial} << D_{\scriptscriptstyle n\phi}$), тогда

$$l = d_{3\partial}.$$
 (13)

Относительная погрешность измерения истинного значения диаметра получаемого проводника, обусловленная конечным значением отношения $l_{n\phi}d_{3\phi}^2/lD_{n\phi}^2$, равна

$$\delta = \frac{(d_{30} - d)}{d_{30}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{l_{n\phi}d_{30}^2}{lD_{n\phi}^2}}}.$$
(14)

Выбор несущей частоты *а*. В приведенных выше выражениях предполагалось, что индуктивная составляющая сопротивления проводника пренебрежимо мала по сравнению с его омическим сопротивлением. Это допущение справедливо только в случае правильного выбора частоты измерительного сигнала *а*.

Индуктивность проводника определяется выражением [7]:

$$L_{l} = 5,08 \cdot 10^{-3} l \left(\ln \frac{l}{\pi r} + 1,193 + 0,223 \frac{\pi r}{l} \right) \left[\mu \Gamma \mu \right], \tag{15}$$

где *l* и *r* измеряются в мм, *r* – радиус проводника.

Например, проводник диаметром 2–200 мкм и длиной 500 мм имеет индуктивность:

$$L_{l} = 5,08 \cdot 10^{-3} l \left(\ln \frac{l}{\pi r} + 1,193 + 0,223 \frac{\pi r}{l} \right) = 5,08 \cdot 10^{-3} 500 \cdot 0,0254 \cdot \left(\ln \frac{500}{\pi (1-100)} + 1,193 + 0,223 \cdot 3,14 \frac{(1-100)10^{-3}}{500} \right) = 0,85 - 0,55 [\text{H}\Gamma\text{H}]$$

В случае неправильного выбора рабочей частоты индуктивная составляющая сопротивления приводит к погрешностям в измерении поперечного сечения проводника. Эквивалентное сопротивление проводника на переменном токе определяется выражением: $Z_l = R_l + j\omega L_l$.

Абсолютная и относительная погрешности измерения сопротивления проводника, обусловленные индуктивной составляющей сопротивления, определяются выражениями (16) и (17) соответственно:

$$\Delta R = R_l - R_{lx} = \frac{4\rho}{\pi} \left(\frac{l}{d_{x0}^2} - \frac{l}{d^2} \right) = 2\pi f l \cdot 5,08 \cdot 10^{-12} \left(\ln \frac{2l}{\pi d} + 1,193 + 0,223 \frac{\pi d}{2l} \right),\tag{16}$$

$$\delta_{R} = \frac{R_{l} - R_{lx}}{R_{l}} = \frac{d_{30}^{2} - d^{2}}{d_{30}^{2}} = \frac{10,16 \cdot 10^{-12} \pi fl \left(\ln \frac{2l}{\pi d} + 1,193 + 0223 \frac{\pi d}{2l} \right)}{4\rho \frac{l}{\pi d_{30}^{2}}}.$$
(17)

Диаметр *d* представим следующим образом:

 $d = d_{_{3\partial}} \pm \Delta d. \tag{18}$

С учетом выражения (18) и принимая, что $(\Delta d)^2 << (d_{3\partial}^2 \pm 2d_{3\partial}\Delta d)$, уравнение (17) принимает вид:

$$\delta_R \approx \frac{d_{30}^2 \pm 2d_{30}\Delta d - d_{30}^2}{d_{30}^2} = \pm 2\frac{\Delta d}{d_{30}} = \pm 2\delta_d = \pm 25 \cdot 10^{-12} \frac{d_{30}^2}{\rho} f\left(\ln\frac{2l}{\pi d} + 1,193 + 0,0223\frac{\pi d}{2l}\right),$$

откуда следует, что

$$\delta_d = \pm \frac{\delta_R}{2} = \pm 12, 5 \cdot 10^{-12} f \frac{d_{30}^2}{\rho} \left(\ln \frac{2l}{\pi d} + 1,193 + 0,223 \frac{\pi d}{2l} \right).$$
(19)

Диаметры измеряются в миллиметрах.

Для заданного значения погрешности δ_d , частота измерительного сигнала выбирается из условия (20):

$$f \leq \delta_d \frac{\rho}{12, 5 \cdot 10^{-12} d_{_{30}}^2 \left(\ln \frac{2l}{\pi d} + 1,193 + 0,223 \frac{\pi d}{2l} \right)}.$$
(20)

ЛИТЕРАТУРА

1. Donici V., Pîrvulescu M. Transmisiuni prin fibre optice. București, Editura Militară, 1994.

2. А.с. 85986 СССР. Способ получения металлической микропроволоки из жидкого металла / Улитовский А.В., Аверин Н.М. Опубл. 1964. Бюл. № 5.

3. А.с. 149168 СССР. Способ изготовления литых проводов в сплошной стеклянной изоляции / Красиньков В.Г., Реман А.В., Трояновский В.В. Опубл. 1965. Бюл. № 3.

4. Патент 9902 Япония. Способ получения микропровода со стеклянной изоляцией / Хоси Цунзо, Сэкигуби Такаси, Сева Дэнси, Кабусики Кайся.

5. Патент 3302803 США. Способ получения проводов в стеклянной изоляции / Walter Dannohl.

6. Дегтярь Л.Э., Зеликовский З.И., Цетенс В.П. Измерение погонного сопротивления микропровода в процессе литья // В сб. Микропровод и приборы сопротивления. Вып. 1. Кишинев, 1962, С. 2431.

7. *Coulton M., Pool W. E.* Проектирование усилителей СВЧ на элементах с сосредоточенными параметрами // Электроника. 1968. № 8. С. 9–21.

Поступила 04.04.2001

Summary

In this paper there is treating an electrical measuring method of conductor (semi-conductor) crosssection in insulation coat during its production by draw from melt; there are analyzes its errors and presenting extreme possibility of this method; there is presenting a block-scheme of arrangement which is realizing this method.